ハプティックインターフェースを用いた微細作業支援システム Micro Tele-Operation Systems with Haptie Interfaces

安藤慶昭^{*}·太田昌宏^{*}·権田晃平^{*}·尹康燮^{*}·橋本秀紀^{*} Noriaki ANDO, Masahiro OHTA, Kouhei GONDA, Kangsup YOON and Hideki HASHIMOTO

1. はじめに

近年, モバイル機器や小型 AV 機器の小型化, 省電力化 に伴い、基盤や部品はより微細なものとなりつつある. 一 方で、特に高度な判断を要する部品のアラインメント等の 作業は、未だに人間が行っている場合が多い、これは、同 様の作業を行うロボットを開発し、学習を行わせるよりも、 人間が行った方が安価で早く作業を遂行でき, 部品の仕様 変更等にも柔軟に対応できるためである.しかしながら, このような作業は、作業者各々の感覚による品質のばらつ きもさることながら、人間にとって非常にストレスフルな 作業である、このようなストレスフルな作業は、人間と対 象物のスケールの違いから生じているにほかならない.対 象物は対象物でそのスケールに合ったマニピュレータ等で 作業を行い、人間は人間のスケールで作業できるような環 境が提供されれば、作業効率が高まると考えられる.本研 究ではこのような状況を,人間の作業空間と微細作業空間 を結ぶテレオペレーションとして捉え、人間と対象物のス ケール問題を解決し、作業時のストレスの緩和と作業効率 の向上を目指す.

操縦されるロボットが対象物と接触した際に,その力情 報をオペレータ側にフィードバックし,操作性を向上させ る技術をバイラテラル制御と呼び,マスタ・スレーブマニ ピュレータの基本技術として古くから研究されてきた^{1),2)}. これを用いると,視覚情報だけでは得ることのできない, 対象物の質感などの情報をオペレータに伝えることがで き,作業効率を高めることができる.本研究ではマイクロ ロボットの製作や微細部品の加工・検査を目的とした微細 作業支援システムを想定している.このシステムは,人間 の指の入り込めないほど微細な環境で人間の作業の能力を 越えた繊細な作業を行う際に用いる,人間の手先を負のス ケールに拡張するツールとして考えることができる.

*東京大学生産技術研究所 情報・システム大部門

2. 微細作業支援システム

本研究で構築した微細作業支援システムの構成を図1に 示す.オペレータが操作する側のハプティック・インター フェース¹をマスタ・デバイス,作業を行う側のマニピュ レータをスレーブ・マニピュレータと呼ぶ.マスタ・デバ イスには、本研究で開発したハプティック・インターフェ ースを用い、スレーブとのバイラテラル・テレオペレーシ ョンを実現する.スレーブ・マニピュレータには、本研究 で開発した独自の機構を持つパラレルリンク型マニピュレ ータを用いている.マスタとスレーブは互いに Ethernet で 接続され、ネットワークを介したテレオペレーションを行 うことができる.また、スレーブ・システムは PHANToM 等の市販されている汎用的なハプティック・インターフェ ースとの接続も可能である.

3. スレーブ・マニピュレータ

本研究では、スレーブ・マニピュレータとしてパラレル リンク機構^{3),4)}のマニピュレータを用いている.一般的 にロボットアーム等のシリアルリンク機構のマニピュレー タは、ワークスペースが広く機構が簡単であるため制御が



図1 微細作業支援システムの構成

容易である.その一方で,精度,剛性が低く応答も遅い傾向がある.パラレルリンク機構は,ワークスペースが狭く 特異点も生じやすいが,シリアルリンク機構にくらべ,高 精度,高速度,高負荷の作業に適しているといわれている⁵⁾. 本研究で対象とするマイクロマシンの組立や微細部品の取 り扱いなどの微細作業においては,数mm ~数+ µm オー ダーの精度を必要とするため,精度,剛性の高いものが望 まれる.したがって,後者のパラレルリンク機構が適して いるとの判断からこの機構を採用した.

なお、本研究で開発したパラレルリンク型スレーブ・マ ニピュレータは、一般的なパラレルリンク機構とは多少異 なる機構を有している.

図2に示すように、ベース部分から出ている6本の伸縮 リンクが2本結合し、エンドエフェクタを支えるテーブル を3点で支持する独自の構造となっている.このような機 構を採用することで、従来に比べ省スペースを実現できる. その反面、運動学や静力学が難解となる.また、一般的な パラレルリンク機構はこれまで多くの解析が行われてお り、ワークスペース等が分かっているが、本パラレル・マ ニピュレータのワークスペースは未知である.

設計する上での大まかな仕様としては、ワークスペース を位置3自由度について最大30mm×30mm×30mm, 回転3自由度についてはすべて±15度の範囲で動作可能 なマニピュレータとした.しかしながら、今後シミュレー タにより正確なワークスペースと特異点を解析する必要が ある.

微小な対象物に接触し実際に作業を行う部分であるエン ドエフェクタは、テーブルの中心に取り付けられた6自由 度力覚センサ(BLオートテック製NANOセンサ)から伸 びている.現時点ではプロトタイプとして針型のエンドエ フェクタが取り付けられている.今後は、ピッキング、は んだ付け、穴開けなどのタスクに応じ付け替え可能な各種 エンドエフェクタを搭載する.

3.1 スレーブ・マニピュレータ

スレーブ・マニピュレータのシステム構成を図3に示 す.モータ制御を2.5 kHzの制御ループで行うために,OS



図2 スレーブ・マニピュレータの外観と構造

には Real Time Linux (RT-Linux) を用いている. モータ, ロータリーエンコーダ, 力センサ等との入出力は, 拡張バ スに接続された AD, DA, カウンタ, DIOの各ボードに より行われる. アクチュエータはいずれも同型の AC サー ボモータが6個搭載されており, 各モータの先にはピッチ が1 mm のボールネジが接続されている.

3.1.1 逆運動学

運動学解析のための座標系を図4のように設定した. ベース座標系を基準座標として、O点をその原点とした. O点から6本のリンクまでの距離を*a*とし、伸縮するリン ク部分の長さを l_i (*i*=1…6)とする.位置指令として、 エンドエフェクタの先端F点の座標 (*x*, *y*, *z*)と、ベース 座標系から見たテーブルの姿勢を (ϕ, θ, ψ)とする.テー ブルの姿勢はオイラー角 (ϕ, θ, ψ),あるいはロールピッ チヨー角 (ϕ, θ, ψ)から求められる回転行列^B R_T によって 表現することができる⁶.

スレーブ・マニピュレータに与えられる指令値はエンド エフェクタの先端 F 点のベース座標系から見た座標 (x, y, z) と,テーブルの姿勢 (ϕ, θ, ψ) である.逆運動学はこ の指令値である (x, y, z) と (ϕ, θ, ψ) から,そのとき必要 な各リンクの長さ l_i $(i=1 \cdots 6)$ を求める計算である.

ここでF点のベース座標系から見た座標(x, y, z)をベ



図3 スレープ・マニピュレータシステム



図4 パラレルリンク座標系

クトル^{*B*} P_F で表すと、ベース座標系から見た C_{12} 点の座標 を示すベクトル^{*B*} $C_{12} = (x_{C_{12}}, y_{C_{12}}, z_{C_{12}})$ は

で表される. ${}^{B}EF$, ${}^{B}ED_{12}$, ${}^{B}C_{12}D_{12}$ はいずれもベース座標 系から見たベクトルであり、テーブルの姿勢を表す回転行 列 ${}^{B}R_{r}$ を用いて、

と表すことができ、ベース座標系から見た C_{12} 点の座標を示すベクトル $^{B}C_{12}$ を計算することができる. C_{12} , C_{34} , C_{56} についてそれぞれ解くと、

$$C_{12} = \begin{bmatrix} x_r + R_{11}d - R_{13}(e+c) \\ y_r + R_{21}d - R_{23}(e+c) \\ z_r + R_{31}d - R_{33}(e+c) \end{bmatrix}$$

$$C_{34} = \begin{bmatrix} x_r - R_{11}d\sin\frac{\pi}{6} + R_{12}d\cos\frac{\pi}{6} - R_{13}(e+c) \\ y_r - R_{21}d\sin\frac{\pi}{6} + R_{22}d\cos\frac{\pi}{6} - R_{23}(e+c) \\ z_r - R_{31}d\sin\frac{\pi}{6} + R_{32}d\cos\frac{\pi}{6} - R_{33}(e+c) \end{bmatrix}$$

$$C_{56} = \begin{bmatrix} x_r - R_{11}d\sin\frac{\pi}{6} - R_{12}d\cos\frac{\pi}{6} - R_{13}(e+c) \\ y_r - R_{21}d\sin\frac{\pi}{6} - R_{22}d\cos\frac{\pi}{6} - R_{23}(e+c) \\ z_r - R_{31}d\sin\frac{\pi}{6} - R_{32}d\cos\frac{\pi}{6} - R_{23}(e+c) \\ z_r - R_{31}d\sin\frac{\pi}{6} - R_{32}d\cos\frac{\pi}{6} - R_{33}(e+c) \end{bmatrix}$$

$$\dots \dots (3)$$

一方,ベース座標系における B_1 点の座標はリンク長 l_1 を 用いて $B_1 = (x_{B_1}, y_{B_1}, z_{B_1}) = (a \cos \frac{\pi}{6}, -a \sin \frac{\pi}{6}, l_1)$ と表すことができ る.ここでベクトル BB_1C_1 について考えると,このベクト ルの大きさはサブリンクの長さ*b*であり,一定であるた め,

$$\left|{}^{B}B_{1}C_{1}\right|^{2} = (x_{c_{12}} - x_{B_{1}})^{2} + (y_{c_{12}} - y_{B_{1}})^{2} + (z_{c_{12}} - z_{B_{1}})^{2} \cdots (4)$$

が成立し、リンクとサブリンクの位置関係を考慮すると、

$$l_1 = z_{c_{12}} - \sqrt{b^2 - \left(x_{c_{12}} - \alpha \cos \frac{\pi}{6}\right)^2 - \left(y_{c_{12}} - \alpha \sin \frac{\pi}{6}\right)^2} \quad \cdots \quad (5)$$

が得られる.これにより、リンク長 l_1 を、指令値であるエ ンドエフェクタの先端F点の座標 (x, y, z)及び姿勢 (ϕ , θ , ψ)によって表すことができ、

$$l_{1} = z_{c_{12}} - \sqrt{b^{2} - \left(x_{c_{12}} - a\cos\frac{\pi}{6}\right)^{2} - \left(y_{c_{12}} - a\sin\frac{\pi}{6}\right)^{2}} \\ l_{2} = z_{c_{12}} - \sqrt{b^{2} - \left(x_{c_{12}} - a\cos\frac{\pi}{6}\right)^{2} - \left(y_{c_{12}} - a\sin\frac{\pi}{6}\right)^{2}} \\ l_{3} = z_{c_{34}} - \sqrt{b^{2} - x_{c_{34}}^{2} - \left(y_{c_{34}} - a\right)^{2}} \\ l_{4} = z_{c_{34}} - \sqrt{b^{2} - \left(x_{c_{34}} - a\cos\frac{\pi}{6}\right)^{2} - \left(y_{c_{34}} - a\sin\frac{\pi}{6}\right)^{2}} \\ l_{5} = z_{c_{56}} - \sqrt{b^{2} - \left(x_{c_{56}} + a\cos\frac{\pi}{6}\right)^{2} - \left(y_{c_{56}} + a\sin\frac{\pi}{6}\right)^{2}} \\ l_{6} = z_{c_{56}} - \sqrt{b^{2} - x_{c_{56}}^{2} - \left(y_{c_{56}} + a\right)^{2}}$$
(6)

となり、 $l_{1\sim6}$ 、即ちエンドエフェクタ先端位置が与えられたときの直動リンクの目標値が求められる.

3.2 位置制御実験

本パラレル・マニピュレータは、リンクの長さ1に対し てフィードバックによる位置制御を行っている.

パラレル・マニピュレータのリンク1本を用い,リンク 位置制御実験を行った. 位置制御の制御器は PID 制御を 用い,パラメータはマニュアルで調整し, $K_p = 85.3$, $K_I = 21.2$, $K_D = 0.0106$ とした. 他の5本のリンクは静止 させ,1mmのステップ状の位置指令を与えた結果を図5 に示す.

約10 msec まで定格速度が出力され,約40 msec で目標 位置に達した.今回はPIDパラメータはマニュアルで調 整したが,現在でも十分な制御特性が得られていることが 分かる.

微細作業を行う上で重要なのは速度よりも精度であるため、精度に関して、実験と計算によるシミュレーションを行った.モータの回転分解能はモータのロータリーエンコーダおよび直動リンクのネジピッチから、リンク換算分解能が 0.122 μm であることが分かっている.また、上述の



9

リンク位置制御実験から,エンコーダの読みで2パルス, リンク長に換算して誤差 0.244 µm 以内で制御可能である ことが明らかになった.

この結果から、逆運動学計算を行い、エンドエフェクタ の先端の位置を $(x, y, z \phi, \theta, \psi) = (0$ [mm], 0[mm], 50[mm], 0[rad], 0[rad], 0[rad]) を初期状態として、各変位方向に平 行移動させたときのリンクの変位を計算した.この結果を 表1に示す.

リンクが約 0.244 µm の誤差で制御可能であることを考 えると,目標精度を 10 µm とした場合には誤差が約 10 % 以内で制御可能であることが分かる.また,パラレル・マ ニピュレータ本体の機構は,仕様により繰り返し精度が 1 µm である.したがって,本パラレル・マニピュレータ は,モーションレベルで 10 µm の精度で制御可能なシス テムであるといえる.

4. マスタデバイス

本研究ではマスタデバイスとしてシリアルリンク機構の 6 自由度ハプティック・デバイスを開発した(図6).スレ ーブマニピュレータは精度や剛性の点から,パラレルリン ク機構を採用している.これに対し,マスタデバイスはコ ンパクトながら広いワークスペースを得るため,シリアル リンク機構を採用した.XYZの並進運動にリニアサーボ モータを用い,X軸リニアモータの上に直接Y軸リニア モータを,Y軸リニアモータの上に直接Z軸リニアモータ

	de la companya de la					
Tip	link1	link2	link3	link4	link5	link6
1.0 (x)	0.000	0.000	0.272	0.273	0.273	0.272
1.0 (y)	0.315	-0.314	-0.157	0.157	-0.157	0.157
1.0 (z)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.0 (x)	0.001	0.001	2.722	2.725	2.725	2.722
10.0 (y)	3.146	-3.144	-1.571	1.574	-1.571	1.574
10.0 (z)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

表1 エンドエフェクタ変位-リンク変位[µm]

図6 マスタデバイスの外観図とリンク構造

3 |

を設置することで,コンパクトながら広いワークスペース を得るとともに無駄な摩擦やヒステリシスを排除し,応答 速度を高める構造となっている.また回転3自由度につい ても,Z軸のリニアモータから3個のACサーボモータを 接続している.6番目のモータの先に力覚センサを設置 し,さらにその先は棒状の把持部分になっている.オペレ ータはこの棒をジョイスティックのように把持し操作す る.可動範囲は平行移動のX軸,Y軸,Z軸ともに20 cm, 回転はX軸,Y軸,Z軸についてそれぞれ±15 deg であ る.

4.1 マスタデバイスシステム

制御 PC および I/O システム構成はほぼスレーブ・マニ ピュレータと同様のハードウエアを用いている(図7). OS はスレーブと同様に Real Time Linux であり,制御ルー プはモータの仕様から 2.5 kHz とした.

4.2 運動学

マスタデバイスの運動学はその構造から非常に簡単となり、XYZの並進方向はそのままリニアモータの変位であり、回転方向も姿勢をロール・ピッチ・ヨー角 (ϕ , θ , ψ) で表すと、そのままモータの回転角度となる.

4.3 フリーモーション実験

ハプティック・デバイスは、スレーブからのフォースフ ィードバックがない場合、即ち反力が0の場合、オペレー タの動きに追従してできる限り軽く動かなければならな い.したがって、その基本的特性を測定するためにフリー モーション実験を行った。以下に平行移動のX軸,Y軸, Z軸の3つのリニアモータを用い、オペレータがジョイス ティック型の把持部分を握り、螺旋状に操作したフリーモ ーション実験結果を示す。

力の PD 制御器のパラメータはマニュアルで調整し、X 軸については $K_p = 12.5$, $K_p = 0.0125$, Y軸については $K_p = 15.6$, $K_D = 0.0625$, Z軸については $K_p = 4.06$, $K_D = 0$ とした.

表2から,非制御時には手で動かすことが困難である



図7 マスタディバイスのシステム構成

が、制御時には比較的軽く操作できることが分かる.

デバイスの軌跡を図8に示す.軌跡はほぼ螺旋を描いて いるが,XY平面で軌跡をみると,滑らかな円を描いてお らず,一部X方向に直線部分が見られる.これはY軸に くらべ,X軸がより軽い力で動くためである.すなわち, X軸,Y軸,Z軸に等しい大きさの力指令が入力されて も,それぞれの軸によってアクチュエータの性能や摩擦, 慣性などの条件が異なるため,その応答が異なっているた めであると考えられる.今回の制御器は,各モータの制御 特性を最が良くなるように調整を行った.しかし,今後, それぞれのモータの対力制御特性が等しくなるような制御 器の設計を行う必要がある.

5. テレオペレーション

5.1 制御系

マスタデバイスと、スレーブマニピュレータを Ethernet で接続し、力帰還型のバイラテラル制御系を構築した.本 力帰還型バイラテラル・テレオペレーションの制御ブロッ ク図を図9に示す.

5.2 フリーモーション実験

まず,スレーブの追従特性を調べるため,フリーモーション実験を行った.力帰還型バイラテラル・テレオペレーションシステムではスレーブ・マニピュレータはマスタ・ デバイスの位置を指令値として位置制御を行い,マスタ・ デバイスはスレーブ・マニピュレータの力覚センサの値を 指令値として力制御を行う.

マスタ・デバイスの力に関する PD 制御器のパラメータ は、X 軸については $K_p = 4.7$, $K_p = 0.0047$, Y 軸について

表2 デバイス操作時の力覚センサの値

モータ番号	1	2	3
制御なし [N]	10	32	14
フリーモーション制御あり [N]	1.2	1.8	2.8



生 産 研 究 223

は $K_p = 6.6$, $K_D = 0.0066$, Z軸については $K_p = 3.0$, $K_D = 0$ とした. スレーブ・マニピュレータの位置に関する PID 制御器のパラメータは $K_p = 85.3$, $K_I = 21.2$, $K_D = 0.0106$ とした. また, 位置に関するスケーリングファクタ $A_p \varepsilon$ 20とした. フリーモーション実験の結果を図 10 に示す. ここで実線がスレーブ・マニピュレータのエンドエフェク タの先端位置,破線がマスタデバイスの位置である. スレ ーブ・マニピュレータの位置は実際の値にスケーリングフ ァクタの 20 倍を乗じた値である. 図 10 から分かるよう に, スレーブ・マニピュレータはマスタ・デバイスにほぼ 正確に追従している一方, 通信によるわずかな遅延も観測 できる.

5.3 環境接触実験

スレーブ・マニピュレータをテレオペレーションによっ て実際の壁と接触させる実験を行った.制御系はフリーモ ーション実験時と同様である.また,力に関するスケーリ ングファクタA_fを0.6とした.接触させる物体として,硬 い物体を用いることは制御系にとって非常にハイゲインの 力入力と等価になり不安定になりやすい.したがって,金



図9 テレオペレーションの制御ブロック図



11



図11 テレオペレーションによる壁接触実験

属塊表面に厚さ約5mmの固いスポンジを緩衝材として張 り付けたものを接触物体として用いた.壁がYZ平面に平 行になるように金属の塊を置き,Xマイナス方向からテレ オペレーションによってスレーブ・マニピュレータを接触 させた.その結果を図11に示す.上段が各デバイスの位 置,下段が力覚センサの値である.ともに実線がスレー ブ・マニピュレータ,破線がマスタデバイスの値を示して いる.

スレーブ・マニピュレータの力センサの値が51.3 sec 付 近から急激に大きな値を示しており,この時点でスレー ブ・マニピュレータが壁に接触し始めたことを示してい る.この力情報がマスタ・デバイスにフィードバックされ, オペレータに接触を伝えていることが分かる.実際の操作 感でも,マスタ・デバイスを通して,スレーブ側の物体の 感触を得ることができ,さらに,物体表面をなぞる,物体 を押すと言った感触も感じとることができた.しかしなが ら,マスタ・デバイスを速く動かしスレーブマニピュレー タを勢い良く物体に接触させると,通信の遅延により非常 に大きな力がフィードバックされ振動的になることも確認 された.

6.まとめ

本稿では、マイクロロボットの製作や微細部品の加工・ 検査を目的とした微細作業支援システムの開発について、 第一段階としてのマスタ・スレーブ・マニピュレータの運 動学解析、制御およびこれらをネットワークを通して接続 したテレオペレーション実験について述べた.マスタ・ス レーブともに、当初の目的である微細作業を行うのに十分 な特性が得られた.しかしながら、本研究で開発した独自 のスレーブマニピュレータは今後、ワークスペース解析、 動力学解析を行い、最適な制御系の設計を行う必要がある. また,マスタデバイスは摩擦補償,重力補償等を制御系に 組み込み,オペレータにとってより自然な操作感を提供で きるハプティック・インターフェースを構築する必要があ る.

今回はテレオペレーションの制御系に関しては単純な力 帰還型バイラテラル・テレオペレーションを行い,本シス テムにおけるマイクロテレオペレーションの実現可能性を 示すに留まった.しかしながら今後は,ネットワークにお ける遅延を考慮した微細作業に適したテレオペレーション 制御系を設計する必要がある.力帰還型バイラテラル・テ レオペレーションの安定性を高める制御方式には,エネル ギーの流れを考慮した制御系⁷⁾ や,フィードフォワード を付加する方法⁸⁾ などがあり,今後これらを検討した上 で,マイクロテレオペレーション特有のスケーリングファ クタによる影響も考慮にいれた制御系を導入する.

(2000年3月30日受理)

診 考 文 献

- Kazuhiro Kosuge, Tomotaka Itoh, Toshio Fukuda, and Manabu Otsuka, "Tele-manipularion System Based on Task-oriented Virtual Tool", IEEE International Conference on Robot and Automation, pp. 351–356, 1995.
- B. Hannoford, R. Anderson, "Experimental and Simulation Studies of Hard Contact in Force Reflecting Teleoperation", Proceedings of 1988 IEEE International Conference on Robotics and Automation, pp. 584–589, 1988.
- E. F. Fichter, "A Stewart Platform-Based Manipulator: General Theory and Practical Construction", The International journal of Robotics Research, Vol. 5-2, pp157–182, 1986.
- 4) Kevin Cleary, Tatsuo Arai, "A Prototype Parallel Manipulator: Kinematics, Construction, Software, Workspace Results, and Singularity Analysis", Proceedings of the 1991 IEEE International Conference on Robotics and Automation, pp. 566–571, 1991.
- 5) 武田, 舟橋, "パラレルマニピュレータにおける運動伝達特 性", 日本機会学会論文集 (C編), Vol. 59, No. 560, pp. 1142-1147, 1993.
- 6) 吉川, "ロボット制御基礎論", コロナ社, 1988.
- 7) Mark W. Spong, "Communication Delay and Control in Telerobotics", 日本ロボット学会誌, Vol. 11, No. 6, pp. 803-810, 1993.
- 8) 松日楽,浅倉,番場,"フィードフォワードを付加した力帰 還型バイラテラル制御",平成2年日本ロボット学会学術 講演会予稿集,pp.229-230,1990.
 - ¹ ハプティック(haptic):「触覚(に基づく)」の意.ハプテ ィックインターフェース:使用者に対して力覚をフィード バックすることのできるインターフェース